



FPD 露光装置

FX-67S2/67S

第6世代プレートサイズ対応

2 μ mの高解像度を達成したFPD 露光装置



第6世代プレートサイズ対応 2 μm の高解像度を達成したFPD露光装置

FPD露光装置 FX-67S2/67S

第6世代プレートによる高精細中小型パネルの生産に対応。スキャナー方式により、生産性向上と高解像度、高い重ね合わせ精度を同時に実現しました。

特長

●マルチレンズシステムを搭載

複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムを搭載。広い露光領域を確保すると同時に、高解像度を達成。

●高スループット

●高解像度

複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムの高解像度化のために、新たな調整機構を採用し、さらに独自の解像度向上技術を採用した照明系を新規開発。また、計測ポイントを最適化した新オートフォーカスシステムも搭載し、2 μm (L/S)の高解像度を達成しながら、広い実用焦点深度も同時に確保。

●高い重ね合わせ精度

新たに測長干渉計軸を増やし、位置計測システムを新設計したことにより計測安定性が向上し、 $\pm 0.5 \mu\text{m}$ の高い重ね合わせ精度を実現。

●露光性能の向上

独自技術により開発したさまざまなキャリブレーション機能を適用し、総合的により安定した露光性能を実現。

Performance

	FX-67S2	FX-67S
解像度 (L/S)	2.0 μm (g+h+i-line)	
投影倍率	1:1	
重ね合わせ精度	$\leq \pm 0.5 \mu\text{m}$	
最大プレートサイズ	1,500 mm \times 1,850 mm	
タクトタイム	57 sec./plate Conditions: 1,500 mm \times 1,850 mm, 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm ²	61 sec./plate Conditions: 1,500 mm \times 1,850 mm, 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm ²

レーザ光

ビームをのぞきこまないこと

Max. 1mW CW He-Ne 633nm

クラス2 レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご 注 意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

・このカタログは2018年3月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

・このカタログに掲載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

©2018 NIKON CORPORATION

株式会社 **ニコン**

半導体装置事業部 営業部 108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 電話(03)6433-3641

株式会社ニコンテック 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911

<http://www.nikon.co.jp/pec>